

**Редакционная коллегия**

**Н. Л. Истомина**, д-р физ.-мат. наук, Московский авиационный институт, кафедра Управление инновациями, Московский университет геодезии и картографии, кафедра оптико-электронных приборов (Москва)

**А. В. Наумов**, член-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, Институт спектроскопии РАН, Московский педагогический государственный университет, заведующий кафедрой теоретической физики им. Э. В. Шпольского (Москва)

**А. С. Борейшо**, д-р техн. наук, Институт лазерной техники и технологий Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова (Санкт-Петербург)

**Г. Т. Микаелян**, д-р техн. наук, «НПП «ИНЖЕКТ», Институт магистратуры НИЯУ МИФИ (Саратов)

**Е. В. Земляков**, канд. техн. наук, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Институт лазерных и сварочных технологий (ИЛИСТ) (Санкт-Петербург)

**В. Ю. Венедиктов**, д-р физ.-мат. наук, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург)

**О. А. Алексеева**, д-р физ.-мат. наук, ФНИЦ «Курчатовский институт» (Москва)

**И. С. Шелемба**, канд. техн. наук, ООО «Инверсия-Сенсор» (Пермь)

**Председатель редакционного совета:**

**И. Б. Ковш**, д-р физ.-мат. наук, президент Лазерной ассоциации

**Редакционный совет**

**С. А. Бабин**, член-корреспондент РАН, д-р физ.-мат. наук, Институт автоматизации и электрометрии СО РАН (Новосибирск)

**Ю. В. Бажанов**, д-р техн. наук, ОАО НПК «Системы прецизионного приборостроения» (Москва)

**А. В. Будаговский**, д-р техн. наук, ВНИИ генетики и селекции плодовых растений им. И. В. Мичурина (Тамбовская обл., Мичуринск)

**Г. И. Долгих**, академик РАН, Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева ДВО РАН (Владивосток)

**А. В. Карменян**, д-р техн. наук, Государственный университет ДонгХва (Хуалинь), Исследовательский центр биофотоники и молекулярной визуализации, Национальный Ян Мин университет Тайпея (Тайпей)

**В. Н. Крутиков**, д-р техн. наук, ВНИИ оптико-физических измерений, Высшая школа экономики (Москва)

**Е. В. Кузнецов**, д-р техн. наук, НИИ «Полус» им. М. Ф. Стельмаха, Москва

**А. А. Лутовинов**, член-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, Институт космических исследований РАН (Москва)

**В. П. Минаев**, канд. техн. наук, «НТО ИРЭ-Полус», группа компаний IPG Photonics

**В. В. Осипов**, член-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, Институт электрофизики УрО РАН, Уральский физико-технический университет (Екатеринбург)

**Р. В. Ромашко**, член-корр. РАН, д-р физ.-мат. наук, Институт автоматизации и процессов управления ДВО РАН (Владивосток)

**Г. А. Турчин**, д-р техн. наук, Санкт-Петербургский государственный технический морской университет, Институт лазерных и сварочных технологий (ИЛИСТ СПбГТМУ), АО «Центр технологии судостроения и судоремонта»

**Чжу Сяо**, директор Национального исследовательского центра лазерных технологий Хуанжонского университета, президент Лазерной ассоциации оптической долины Китая, (Ухань, провинция Хубэй, Китай)

**В. Я. Шур**, д-р физ.-мат. наук, Институт естественных наук и математики Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина, Уральский центр коллективного пользования «Современные нанотехнологии» (Екатеринбург)

**И. А. Щербаков**, академик РАН, д-р физ.-мат. наук, Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Московский физико-технический институт (МФТИ) (Москва)

## Конференции, выставки, семинары

**180** *А. В. Наумов, Д. В. Левашова*  
**«ФОТОНИКА-2025»: четыре новеллы о будущем**

## Технологическое оборудование и технологии

**192** *М. В. Кузнецов, М. В. Ларин, Д. А. Кузнецова, А. А. Попович*  
**Оценка остаточных деформаций сварного соединения, образованного при различных способах сварки**

**210** *В. В. Лиханский, К. Е. Улыбышев, Н. Н. Елкин, М. В. Хорохорин*  
**Изменения микроструктуры поликристаллических сплавов при ударном воздействии короткими лазерными импульсами**

## Оптические устройства и системы

**224** *И. П. Шишкин, А. П. Шкадаревич*  
**Объективы с внутренней фокусировкой**

## Квантовые технологии

**232** *В. Г. Криштон*  
**Источники одиночных фотонов: обзор. Часть 4**